

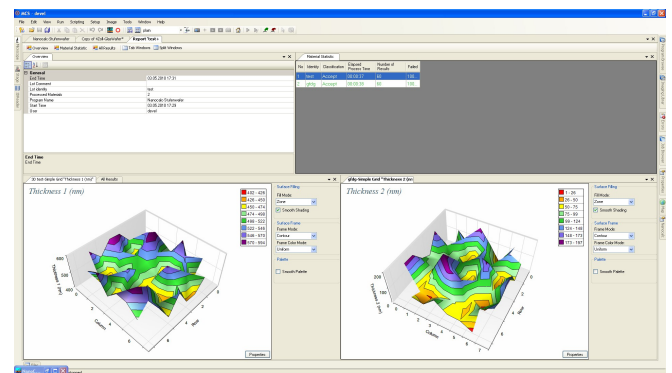
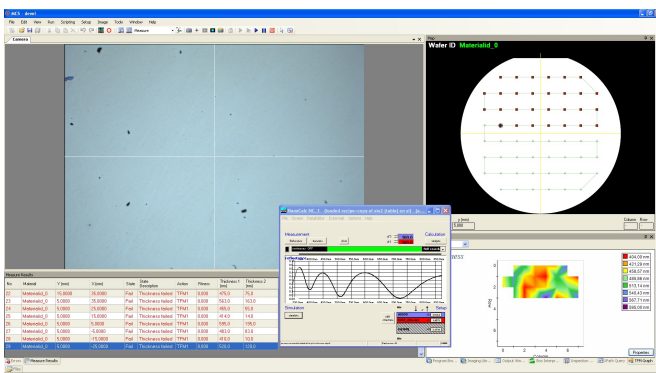
MCS TF

Vollautomatische Schichtdickenmessstation

Die robuste Lösung für Ihre Schichtdicken-Messaufgaben in Produktion und Entwicklung. Für alle optisch transparenten und semitransparenten Materialien. Sichere Messungen auch auf Multilayern (Schichtdicken 50nm bis 50µm).



- **schnell, berührungslos, zuverlässig**
- MCS Software Suite, die moderne Software für Metrology und Inspektion
- präzise Positionierung auf kleinsten Strukturen durch leistungsfähiges pattern alignment
- umfangreicher Schicht- und Materialkatalog im Lieferumfang
- automatisches 2D/3D Schichtdicken- Mapping, Schichtdickenprofile
- fasergekoppeltes Spektrometer (keine bewegten Teile, kein Verschleiß)
- 400-800 nm spektrale Bandbreite
- kleinste Größe des Messpunktes 4µm
- automatisches Hochleistungsmikroskop mit motorisiertem Kreuztisch,
- Laser Autofokus für höchste Reproduzierbarkeit auch bei dünnen Schichten
- Robot Wafer Transport: schnell, sicher und kontaminationsfrei
- Wafer Durchmesser von 100mm bis 300mm (größere Substrate auf Anfrage)
- Reinraumklasse 1 kompatibel



MCS TF

Anwendungsbereiche IC und MEMS

- Messung von dielektrischen Schichten auf Wafern, Glas, Saphir, III-IV Halbleiter (SiO₂, Si₃N₄, Fotolack, ITO...)
- sehr dünne metallische Schichten auf Wafern oder Glas (Ag, Al, Au, Ti, ...)
- SOI Siliziumdicken-Messung (Silicon On Isolator)
- Dickenmessung von gedünnten Wafern
- Dickenmessung von Si Membranen
- Fotolack-Schichtdickenverteilung auf Halbleitermasken
- DVD/CD Beschichtungen
- Linsenbeschichtungen (Antikratz- und Antireflexions-Schichten)
- DLC (Diamond Like Carbon) Hartschichten
- Foliendicken
- Luftspalt zwischen Maske und Wafer bei Belichtungsanlagen
- sehr dicke Fotolacke im Bereich der Mikromechanik (100µm bis ca. 250µm)
- theoretische Schichtsimulation
- Messung von Mehrschichten
- 3D-Dickenprofilermittlung

Optionen:

- MCS-CD Strukturbreitenmessung
- Overlaykontrolle
- MCS-IS Inspektion und Review (KLA - KLARF Daten)
- MCS-FLY schneller Bildeinzug bei kontinuierlicher Tischbewegung, Inspection & grabbing "on the fly"
- Weisslichtinterferenz WLI und Phaseshift Interferenz PSI
- (VSI vertical scanning interferometry, PSI phase shift interferometry)
- 3D Oberflächenprüfung



ProMicron
Bachmühlweg 24
74366 Kirchheim/Neckar

Internet www.promicron.de
Email info@promicron.de

Phone (+49 7143) 4056-0
Fax (+49 7143) 2086447